## 新博士紹介

- 1. 氏名 志村考功(現:大阪大学工学部精密工学科)
- 2. 論文提出大学 名古屋大学
- 3. 学位の種類 博士(工学)
- 4. 取得年月 1993年8月

 5. 題目 Fundamental apects of X-ray scattering from crystal surfaces and interfaces
6. アブストラクト

平坦な表面を持つ結晶からのX線散乱強度を測 定すると、逆空間において、ブラッグ点から結晶 表面に垂直な方向に延びる棒状の散乱が観測され る。この散乱はX線CTR(Crystal Truncation Rod)散乱と呼ばれており、結晶表面が存在するこ とによる外形効果として理解することができる。 その強度分布は結晶表面の形状に依存しているの で、この強度分布を調べることにより結晶表面の 情報(荒れや格子緩和など)を原子レベルで得る ことができる。近年、X線回折法による結晶表面 の研究は益々盛んになってきているが、その多く がこのCTR散乱を利用している。

運動学的回折理論において,通常,散乱振幅 *A*(*K*)は,

$$A(\mathbf{K}) = \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} F(\mathbf{K}) e^{iKx n_x a_x} e^{iKy n_y a_y} e^{iKz n_z a_z}$$

のように表される。ここで、 $K(K_x, K_y, K_z)$ は散乱 ベクトル、 $a_x^*$ 、 $a_y^*$ 、 $a_z^*$ は逆格子ベクトル、F(K)は構 造因子である。今、z = 0にある理想的に平らな表 面を考えz軸を表面法線方向にとると、A(K)は、 次のように書き直すことができる。

$$\begin{aligned} A(\mathbf{K}) &= \sum_{n_{x}n_{y}} \Phi_{(n_{x},n_{y})}(\mathbf{K}) e^{iKxn_{x}a_{x}} e^{iKyn_{y}a_{y}} \\ \text{ftfl}, \\ \Phi_{(n_{x},n_{y})}(\mathbf{K}) &= \sum_{n_{z}=0}^{N_{z}^{1}(n_{x},n_{y})-1} F(\mathbf{K}) e^{iKzn_{z}a_{z}} \\ &= F(\mathbf{K}) \cdot \{\frac{1}{1-e^{iKza_{z}}} - \frac{e^{iKzN_{z}^{1}(n_{x},n_{y})}}{1-e^{iKza_{z}}}\} \quad (1) \end{aligned}$$

とする。ここで、 $N_{z}^{l}(n_{x}, n_{y})-1$ は、結晶表面にお

ける  $(n_x, n_y)$ の位置での結晶表面と反対側の端の位置を表している。CTR 散乱の強度式は、この  $\Phi_{(n_x, n_y)}(K)$ を使って、

 $I_{CTR}(\mathbf{K}) = I_e \cdot \langle \Phi(\mathbf{K}) \rangle^2$ 

$$\times \sum_{n_{x^{*-\infty}}}^{\infty} \sum_{n_{y^{=-\infty}}}^{\infty} a_{x}^{*} a_{y}^{*} N_{x} N_{y} \delta(K_{x} - n_{x} a_{x}^{*}) \delta(K_{y} - n_{y} a_{y}^{*})$$

と表すことができる<sup>1)</sup>。 $I_e$ は、一つの電子からの散 乱強度を、<....>は、 $(n_x, n_y)$ について平均をと ったことを示している。

ここで、問題となるのは、 < $\Phi(K)$  ><sup>2</sup> である。 Robinson<sup>2</sup>は、この和を、ラウエ関数の分子を平均 することによって次のように取り扱った。

$$|\sum_{n_z=0}^{N_z^{1-1}} e^{iKzn_xa_z}|^2 = \frac{\sin^2\left(\frac{1}{2}K_zN_z^{1}a_z\right)}{\sin^2\left(\frac{1}{2}K_za_z\right)}$$
$$\rightarrow \frac{1}{2\sin^2\left(\frac{1}{2}K_za_z\right)}$$
$$as \ N_z^{1} \rightarrow \infty$$

つまり,

$$<\Phi(\mathbf{K})>^{2} = |F(\mathbf{K})|^{2} \cdot \frac{1}{2\sin^{2}(\frac{1}{2}K_{z}a_{z})}$$
 (2)

とした。

っ

-53-

これに対し、Vlieg<sup>3</sup>等は吸収の効果を考慮する ことにより、

$$\begin{split} \Phi_{(n_x, n_y)}(K) &= F(K) \cdot \sum_{\substack{n_z = 0 \\ n_z = 0}}^{N_z^1(n_x, n_y)^{-1}} e^{iKzn_z a_z} e^{-\mu n_z a_z} \\ &\rightarrow F(K) \cdot \frac{1}{1 - e^{iKzaz} e^{-\mu az}} \\ &\text{as } N_z^1(n_x, n_y) \to \infty \end{split}$$

$$<\Phi(\mathbf{K})>^{2} = |F(\mathbf{K})|^{2} \cdot \frac{1}{4\sin^{2}(\frac{1}{2}K_{z}a_{z})}$$
 (3)

とした。ただし $\mu$ は吸収係数であり、和を取った 後、 $\exp(-\mu a_z) \sim 1$ と近似してある。(2)式は、 (3)式の2倍になっていることが分かる。CTR散 乱の強度を相対強度測定した場合、(2)式と(3) 式の違いは全く問題にならない。そのため、この 違いについて今まであまり論議されることはなか った。しかし、X線回折学上、重要な問題である といえる。本研究では、CTR散乱を絶対強度(入 射X線強度に対する比)で測定することにより、 この2つの取扱いの妥当性を検討した。

絶対強度測定は、イメージングプレートを用い て CTR 散乱と TDS (Thermal Diffuse Scattering) を同時測定することにより行った4°。TDSは原子 の熱振動に起因する散乱であり、弾性定数がわか っている場合には絶対強度を求めることができる。 つまり, TDSの散乱強度からこのとき入射した X 線の強度を見積もることができ、 CTR 散乱の強度 を絶対値化できる。図1にSi(111)ウエハーの111 ブラッグ点周りの CTR 散乱の測定結果を示す。○ が測定値を表している。また、点線がRobinson、 実線が Vlieg 等による取扱いに対する計算結果を 示している。計算はどちらの場合も理想的に平ら な結晶に対する散乱強度である。したがって、ブ ラッグ点から遠く離れたところで,両方の計算値 とも測定値と大きくくずれているのは、実際の試 料の表面が理想的な表面とは違っているためであ



図1 Si (111) ウェハーの111ブラッグ点周りのCTR散 乱の絶対強度分布

ると考えられる。ブラッグ点近傍で計算値と実測 値を比較すると、 Vlieg等の取扱いに対する計算 値が実測値と見事に一致していることが分かる。

## References

- 1) J. Harada: Acta Cryst. A48, 764 (1992).
- 2) I. K. Robinson: Phys. Rev. B33, 3830 (1986).
- 3) E. Vlieg et al.: Surface Sci. 210, 301 (1989).
- 4) T. Shimura and J. Harada: J. Appl. Cryst. 26, 151 (1993).

(受付番号94012)

## 新博士紹介

- 1. 氏名 寺澤昇久(現:京都工芸繊維大学
  - 工芸学部 物質工学科)
- 2. 論文提出大学 東京工業大学
- 3. 学位の種類 博士(理学)
- 4. 取得年月 1993年9月
- 5. 題名 放射光パルス特性を用いた 励起水素原子の衝突脱励起過程に関する研究

6. アブストラクト

励起水素原子の水素分子による衝突脱励起過程 は,原子・分子衝突過程の最も単純なものであり, 化学反応における最も重要な素過程の一つとして 興味深い。励起水素原子の主量子数が互いに等し く軌道角運動量量子数が互いに異なる状態は,エ ネルギー的にほとんど縮退している。また,実験 室で容易に生成することができる励起水素原子 は,H(2s)原子を除くとその自然寿命がきわめて 短い(約ナノ秒)。したがってH(2s)原子を除くと 特定の励起状態にある水素原子のビームを生成す ることはきわめて困難であり,励起水素原子の衝 突過程に関する研究例はきわめて限られてくる。 しかし,最も簡単な原子であって,しかもわずか なエネルギー差で縮退している励起水素原子の衝 突脱励起過程について,その原子の電子状態に依 存した断面積を調べることは反応物理化学の基本 的課題として重要である。そこで,本研究では放 射光のパルス特性を利用して,このような衝突脱